

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 3 部門第 4 区分

【発行日】平成 24 年 4 月 26 日 (2012.4.26)

【公開番号】特開 2011-42854 (P2011-42854A)

【公開日】平成 23 年 3 月 3 日 (2011.3.3)

【年通号数】公開・登録公報 2011-009

【出願番号】特願 2009-193027 (P2009-193027)

【国際特許分類】

C 23C 14/34 (2006.01)

C 01G 23/04 (2006.01)

B 01D 53/86 (2006.01)

B 01J 21/06 (2006.01)

B 01J 35/02 (2006.01)

【FI】

C 23C 14/34 N

C 01G 23/04 C

B 01D 53/36 J

B 01J 21/06 M

B 01J 35/02 J

【手続補正書】

【提出日】平成 24 年 2 月 10 日 (2012.2.10)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0048

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0048】

(光触媒特性の比較 2)

本発明の光触媒薄膜に関して、 TiO_2 膜厚を $40\text{ nm} \sim 120\text{ nm}$ まで段階的に変化させた、基材を準備し、上記の油分解評価法によって評価を行なった。その結果を図 9 に示す。